



ATTESTATION DE PARTICIPATION



Google Meet

3^{ème} SEMINAIRE NATIONAL SUR LA TECHNOLOGIE ET L'INDUSTRIE

Tlemcen le 18 Octobre 2025



ETTACHFINIYA ETILIMSANIA
Edition Imprimerie
Diffusion

Le président du séminaire atteste que :

Riad Dib MCB, Département de Technologie, Faculté de Technologie, Université de Bejaia, Bejaia 06000, Algérie

Khatir Khettab Professeur, Département de Génie Electrique, , Faculté de Technologie, Université de M'sila, M'sila 28000, Algérie

Yassine Bensafia Professeur, Département de Génie Electrique, Facultés des sciences appliquées, Université de Bouira , Bouira 10000, Algérie

Salim Chelbi MCA, Département de Génie Electrique, Facultés des sciences appliquées, Université de Bouira, Bouira 10000, Algérie

Abdenour Mekhmoukh MCA, Département de Génie Electrique, Faculté de Technologie, Université de Bejaia, Bejaia 06000, Algérie

A(ont) participé au 3^{ème} séminaire national sur la technologie et l'industrie organisé par la Startup Pedagogic and Scientific Conferences and Publications Tlemcen en collaboration avec la Maison des Universitaires pour l'édition, l'imprimerie et la diffusion Tlemcen ainsi que de la Maison Ettachfiniya Etilimsania pour l'édition, l'imprimerie et la diffusion Tlemcen qui s'est tenu le 18 Octobre 2025 à Tlemcen par une communication orale intitulée :

Une nouvelle approche pour comparer les méthodes d'approximation pour les systèmes d'ordre fractionnaire



Le président du séminaire



La présidente du comité scientifique



Le président du comité d'organisation